

名 称：第 8 回触媒劣化セミナー

主 催：化学工学会 反応工学部会 触媒反応工学分科会

協 賛：触媒学会 工業触媒研究会（予定）

日 時：2014 年 10 月 24 日（金）13 時～17 時 30 分

会 場：大阪科学技術センター 700 号室（〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4）

地下鉄御堂筋線本町駅下車徒歩約 7 分・地下鉄四つ橋線本町駅下車徒歩約 3 分

（URL: <http://www.ostec.or.jp/index.html>）

講演題目及び講師

13:00～13:05

主催者挨拶

13:05～14:00

「ゼオライト成形体の劣化対策（仮題）」

三井化学株式会社 岡部 晃博 氏

14:00～14:55

「リーンバーン車用 NO_x 吸蔵利用触媒の劣化対策」

株式会社豊田中央研究所 田中 寿幸 氏

14:55～15:05

休憩

15:05～16:00

「水素製造プロセスにおける触媒劣化の実例について」

国際石油開発帝石株式会社 原田 亮 氏

16:00～16:55

「触媒とマイクロリアクターを組み合わせた反応制御」

京都大学 化学工学会会長 前一廣 先生

16:55～17:00

閉会の挨拶

17:10～19:10

懇親会（当日ご案内します）

講演会参加費：化学工学会会員および協賛学会会員：2,000 円、賛助会員：無料、

学生：無料、その他：5,000 円

懇親会参加費：4,000 円

申込方法：電子メールにて氏名、所属、連絡先（住所、電話、電子メールアドレス）、講演会および懇親会双方の出欠を明記の上、下記へお申し込み下さい。

井上 朋也（E-mail: inoue-tomoya@aist.go.jp）； 申込締切日 10 月 17 日（金）

お問合わせ・申込先：

（独）産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター

井上 朋也（E-mail: inoue-tomoya@aist.go.jp）